(19) **日本国特許庁(JP)** 

## (12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

## 特表2009-540500

(P2009-540500A)

(43) 公表日 平成21年11月19日 (2009.11.19)

(51) Int.Cl.			FΙ			テーマコード (参考)
H01J	49/42	(2006.01)	HO1J	49/42		2  GO  4  1
GO1N	27/62	(2006.01)	G O 1 N	27/62	L	5CO38

審查請求 未請求 予備審查請求 未請求 (全 14 頁)

(21) 出願番号	特願2009-514275 (P2009-514275)	(71) 出願人	501192059
(86) (22) 出願日	平成19年5月18日 (2007.5.18)		サーモ フィニガン リミテッド ライア
(85) 翻訳文提出日	平成20年12月5日 (2008.12.5)		ビリティ カンパニー
(86) 国際出願番号	PCT/US2007/012001		アメリカ合衆国 カリフォルニア州 95
(87) 国際公開番号	W02007/145776		134 サン ホセ リヴァー オークス
(87) 国際公開日	平成19年12月21日 (2007.12.21)		パークウェイ 355
(31) 優先権主張番号	60/811, 263	(74)代理人	100082005
(32) 優先日	平成18年6月5日 (2006.6.5)		弁理士 熊倉 禎男
(33)優先権主張国	米国 (US)	(74)代理人	100088694
			弁理士 弟子丸 健
		(74)代理人	100103609
			弁理士 井野 砂里
		(74)代理人	100095898
			弁理士 松下 満
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ランプ関数状の軸方向電位を有する二次元イオントラップ

(57)【要約】

【課題】質量分析器用イオントラップの分解能を改善す る。

【解決手段】本発明は、第1端部電極と第2端部電極と の間に位置する複数の細長い電極を備え、これら複数の 細長い電極と前記第1および第2端部電極とは、トラッ ピング空間を構成する二次元のイオントラップを提供す るものであり、更に前記複数の細長い電極および前記端 部電極の第1の組および前記第2の組と電気通信するコ ントローラは、前記複数の細長い電極のうちの少なくと も1つに印加される周期的な電圧を徐々に変え、よって イオントラップからイオンの質量対電荷比の大きさで径 方向に放出する。同時にコントローラは、前記複数の細 長い電極に対する前記端部電極のうちの少なくとも1つ のDCオフセットを徐々に変えるようになっている。 【選択図】図2



【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1端部電極と第2端部電極との間に位置する複数の細長い電極を備え、これら複数の 細長い電極と前記第1および第2端部電極とは、トラッピング空間を構成し、更に前記複 数の細長い電極および前記端部電極の第1の組および前記第2の組と電気通信するコント ローラとを備え、前記コントローラは前記複数の細長い電極のうちの少なくとも1つに印 加される周期的な電圧を徐々に変え、よってイオントラップからイオンの質量対電荷比の 大きさでイオンを径方向に放出すると共に、同時に前記複数の細長い電極に対する前記端 部電極のうちの少なくとも1つのDCオフセットを徐々に変えるようになっている二次元 イオントラップ。

【請求項2】

前記コントローラは、前記複数の細長い電極に対する前記第1および第2端部電極のD Cオフセットを同時に徐々に変えるようになっている、請求項1に記載の二次元イオント ラップ。

【請求項3】

前記コントローラは、一連のステップで前記DCオフセットを変えるようになっている、請求項1又は2に記載の二次元イオントラップ。

【請求項4】

前記ステップは、離散的である、請求項3に記載の二次元イオントラップ。

【請求項5】

前記放出されるイオンの前記質量対電荷比が増加するにつれ、前記コントローラはDC オフセットの大きさを増加するようになっている、請求項1乃至4の何れか1項に記載の 二次元イオントラップ。

【請求項6】

前記コントローラは、前記質量対電荷比に対し、前記DCオフセットの値をリニアに増加する、請求項1乃至5の何れか1項に記載の二次元イオントラップ。

【請求項7】

前記コントローラは、特定の質量対電荷比の値の放出されたイオンに対して望まれる特定された最大ピーク幅に基づき、DCオフセットの大きさを増加する、請求項1乃至5の何れか1項に記載の二次元イオントラップ。

【請求項8】

前記周期的電圧は、 R F トラッピング電圧である、請求項1乃至7の何れか1項に記載 の二次元イオントラップ。

【請求項9】

前記第1および第2端部電極の各々は、前記細長い電極の対応する電極と同心状に配置 された複数のロッド電極を備える、請求項1乃至8の何れか1項に記載の二次元イオント ラップ。

【請求項10】

前記イオンは、前記細長い電極のうちの1つ以上に形成された少なくとも1つの開口部 を通して放出される、請求項1乃至9の何れか1項に記載の二次元イオントラップ。 【請求項11】

第1端部電極および第2端部電極と、複数の細長い電極とを有する二次元イオントラップから逐次イオンを放出する質量のための方法であって、

(a)前記細長い電極のうちの少なくとも1つに印加される周期的な電圧を徐々に変え、よってイオンの質量対電荷比の大きさで前記イオントラップから径方向にイオンを放出 するステップと、

(b)前記ステップ(a)と同時に、前記複数の細長い電極に対する前記端部電極のうちの少なくとも1つのDCオフセットを徐々に変えるステップとを備える、質量のための 方法。

【請求項12】

10

20

30

前 記 複 数 の 細 長 い 電 極 に 対 す る 前 記 第 1 お よ び 第 2 端 部 電 極 の D C オ フ セ ッ ト を 徐 々 に 変えるステップを更に備える、請求項11に記載の方法。 【請求項13】 ー連のステップで前記DCオフセットを変えるようになっている、請求項11乃至14 の何れか1項に記載の方法。 【請求項14】 前記ステップは、離散的である、請求項11又は12に記載の方法。 【請求項15】 前記放出されるイオンの前記質量対電荷比が増加するにつれ、前記コントローラは、D 10 C オフセットの大きさを増加させる、請求項11乃至14の何れか1項に記載の方法。 【請求項16】 前記放出されるイオンの質量対電荷比の大きさが増加するにつれ、前記DCオフセット の値は、リニアに増加する、請求項11乃至15の何れか1項に記載の方法。 【請求項17】 特定の質量対電荷比の値の放出され、選択されたイオンに対して望まれる分解能により 、DCオフセットの大きさを増加する、請求項11乃至16の何れか1項に記載の方法。 【請求項18】 前 記 周 期 的 電 圧 は 、 R F ト ラ ッ ピ ン グ 電 圧 で あ る 、 請 求 項 1 1 乃 至 1 7 の 何 れ か 1 項 に 記載の方法。 20 【請求項19】 前記第1および第2端部電極のうちの少なくとも1つは、前記細長い電極の対応する電 極と同心状に配置された複数のロッド電極を備える、請求項11乃至18の何れか1項に 記載の方法。 【請求項20】 前記細長い電極のうちの1つ以上に形成された少なくとも1つの開口部を通してイオン を放出するステップを更に備える、請求項11乃至19の何れか1項に記載の方法。 【発明の詳細な説明】 【技術分野】 本発明は、一般的には質量スペクトルメータとして作動する二次元の四極イオントラッ 30 プに関する。 【背景技術】 [0002]ニ次元(リニア)の四極イオントラップは、RF電圧、直流電圧またはそれらの組み合 わせを電極に印加することにより発生する実質的に四極の静電電位により、複数の電極ま たはロッド構造によって形成されるトラッピング空間内にイオンを導入または形成し、こ の容積内に保持する装置のことである。 [0003] イオントラップ性能を損なうことなく、二次元イオントラップのための高い歩留まり率 を維持するための製造上の試みが常になされている。イオントラップの性能は、例えばイ 40 オントラップ自身の構造および作動モードを含む多くの事項によって決まる。 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ 二次元イオントラップ内で質量選択的不安定性スキャンを使用する際、(一部の研究者 は四極電極のうちの2つの間にイオンを注入しているが)1つ以上の電極内の開口部を通 して径方向にイオントラップからイオンは最も効率的に放出される。装置からイオンを放 出できるように、二次元イオントラップ電極のうちの1つ以上に開口部(単数または複数 )がカットされているとき、理論的な四極電位からの電位が低下するので、この開口部が 存在することハ、性能上のいくつかの重要な要素に影響を与え得る。 50

(3)

[0005]

二次元イオントラップ内に開口部を設けることは、理論的な四極電位を低下させるだけ でなく、ロッド自身の構造上の完全性も低下させるので、軸方向(電極の長さに実質的に 平行な方向)の機械的な偏差を生じさせ、最終的には質量スペクトルメータとして使用さ れるときのかかるイオントラップによって得られる分解能のような性能上の特性に影響す る。

(4)

[0006]

二次元イオントラップの性能は、三次元イオントラップよりも機械的な誤差の影響を受 けやすい。三次元イオントラップでは、イオンのすべてがイオントラップの中心にある球 形または楕円の空間、一般には直径が約1mmのイオンクラウドを占める。しかしながら 、二次元イオントラップ内のイオンは数cm以上となり得る軸方向のイオントラップの全 長のうちのかなりの部分に沿って拡散する。従って、ロッドの幾何学的欠陥、不整合また は電極の成形ミスは、二次元イオントラップの性能に実質的に影響を与える。例えば、電 極のかなりの長さに沿って四極電極が平行でない場合、イオントラップ内の異なる軸方向 位置にあるイオンは、若干異なる電界強度を受けるので、g値が若干異なることになる。 このようなq値の変動は、質量分析中にそれぞれの軸方向位置によって放出時間が決まる 。この結果、全体のピーク幅が広がり、分解能が低下することになる。

上記のように二次元イオントラップが製造された後に、イオントラップが不合格となる 20 1 つの理由は、作動中の分解能が不良となることである。二次元イオントラップの解像度 は、一般にピークの幅(分解能=質量/ピーク幅)に換算して特定される。 

軸方向の磁界の不均一性を生じさせる器械的な誤差の他に、電極の端部だけでなく、電 極内にカットされているスロットの端部によっても生じるフリンジ電界も、装置の長手方 向に沿った径方向の四極電界の強度の大きな偏差を生じさせる。電界を理想的に均一に維 持するには、イオン放出開口部を電極の全長に沿って延ばすことになるが、このことは構 造上の課題を多数生じさせる。これらを防止するために、イオン放出スロットは、一般に イオントラップの全長の中心領域の一部(例えば60%)に沿ってしか位置していない。 しかしながら、このことはロッドの端部の効果の他に、スロットの端部の近くの径方向の 四極電位のずれを生じさせる。従って、これら領域にあるイオンは、装置の中心に多くあ るイオンとは異なる時間に放出されることになり、このことも質量分解能を低下させる結 果を生じさせる。

[0009]

かかる装置に対する分解能は、大型の軸方向トラップ電界を利用することによって改善 することが知られている。このことは、図1から理解でき、図中の曲線105は、軸方向 の位置(イオントラップの軸方向に沿ったイオンクラウドの位置)を関数とする軸方向の 電位を示す。軸方向の大きいトラップ電界は、イオンクラウドの軸方向の拡散を低減し、 イオンクラウドが、磁界の小さい不均一性しか受けないようにクラウドを圧縮する。この ことは、得られるq値の変動をより小さくでき、その結果、分解能がより良好となる。不 幸なことに、イオンクラウドを圧縮することは、空間電荷によって誘導される質量のシフ トを同時に増加させる。このことは、この装置におけるイオン蓄積空間または空間電荷容 量を脅かす。最終的に、このように軸方向の電位が変わるので、分解能と空間電荷容量と を妥協させなければならない。

従って、空間電荷容量に与える影響を最小にしながら、分解能を高める改善された二次 元イオントラップおよびかかる二次元トラップを作動させる方法が望まれている。

【課題を解決するための手段】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 

本発明の1つの様相によれば、上記欠点またはその他の多くを克服した装置よび方法が 開示される。

10

本発明は、第1端部電極と第2端部電極との間に位置する複数の細長い電極を備え、こ れら複数の細長い電極と前記第1および第2端部電極とは、トラッピング空間を構成する ニ次元のイオントラップを提供するものであり、前記複数の細長い電極および前記端部電 極の第1の組および前記第2の組とコントローラが電気通信するようになっており、この コントローラは、前記複数の細長い電極のうちの少なくとも1つに印加される周期的な電 圧を徐々に変え、よってイオントラップからイオンの質量対電荷比の大きさでイオンを径 方向に放出する。同時にコントローラは、前記複数の細長い電極に対する前記端部電極の うちの少なくとも1つのDCオフセットを徐々に変えるようになっている。

一般的に本発明の1つに様相によれば、前記コントローラは、前記複数の細長い電極に 対する前記第1および第2端部電極のDCオフセットを同時に徐々に変えるようになって いる。前記DCオフセットを一連のステップで変えてもよく、前記一連のステップを離散 的にしてもよい。前記コントローラは、前記質量対電荷比の増加とともに、DCオフセッ トの大きさを増加できる。前記コントローラは、質量対電荷比に対し、前記DCオフセッ トの大きさをリニアに増加できる。

[0014]

特定の実現例は、次の特徴の1つ以上を含むことができる。前記コントローラは、特定 の質量対電荷比の値の放出されたイオンに対して望まれる特定された最大ピーク幅に基づ き、DCオフセットの大きさを増加できる。前記第1および第2端部電極は、前記細長い 電極の対応する電極と同心状に配置された複数のロッド電極を備える。 [0015]

本発明の1つの特徴によれば、第1端部電極および第2端部電極と、複数の細長い電極 とを有する二次元イオントラップから逐次イオンを放出する質量のための方法は、1つ以 上のステップを含むことができる。例えば、これらステップは、前記細長い電極のうちの 少なくとも1つに印加される周期的な電圧を徐々に変え、よってイオンの質量対電荷比の 大きさだけ前記イオントラップから径方向にイオンを放出するステップを含むことができ 、この方法は、更に周期的電圧を徐々に変えるステップと同時に、前記複数の細長い電極 に対する前記端部電極のうちの少なくとも1つのDCオフセットを徐々に変えるステップ も備える。

[0016]

本発明は、次の利点の1つ以上を実現するように実施できる。徐々に変化するDCオフ セットを利用することにより、特定の質量対電荷比またはその値のレンジに対して、分解 能を改善できる。徐々に変化するDCオフセットを利用することにより、固定されたDC オフセットと比較し、質量対電荷比のより広いレンジにわたって分解能を完全できる。更 に徐々に変化するDCオフセットを利用することによって、例えば固定されたDCオフセ ットを使用した場合に不合格となる分解能の仕様を、二次元イオントラップが満たすこと できるようになる。

次の詳細な説明、図面並びに請求項を読めば、本発明の別の利点および特徴が明らかと なろう。

本発明の特徴および目的を更に良好に理解するために、添付図面と共に次の詳細な説明 を参照する。

[0019]

いくつかの図面にわたり、同様な参照番号は対応する部品を示す。

【発明を実施するための最良の形態】

[0020]

図2には、二次元イオントラップ200が示されており、このイオントラップは端部レ ンズ、すなわち電極210および215に印加されたDC電圧だけで得られる軸方向のト 50

10

30

ラップを有する単一部分205を備える。

【0021】

二次元状の実質的な四極の構造体200は、複数の細長い電極またはロッドを備え、特殊な場合、2対の対向する細長い電極、すなわち第1ペア220、225と、第2ペア230、235とを備える。この図では、以下、約束として細長い電極ペアは、×およびy軸に整合し、よって第1ペア220、225をXの細長い電極ペアとして表示し、第2ペア230、235をYの細長い電極ペアとして表示する。これら細長い電極は、第1端部プレート(またはレンズ)215との間に位置している。作動時に、これら電極210、215、220、225、230および235は、トラッピング空間240を構成する。端部電極210のうちの少なくとも1つは、開口部245を有し、この開口部を通してイオンを放出できる。内部とラッピング空間240を構成する。ことができる。イオントラップ200に進入する矢印250の方向のイオンに対してゲート操作するように、入射端部電極210を使用できる。イオンをトラップするためにトラッピング空間240の電位とは異なっている。

[0022]

Xの細長い電極ペア220および225のうちの少なくとも1つにおける細長い開口部 255により、四極イオントラップ構造体200の中心軸線265に直交する方向となっ ている矢印260の方向に(質量選択的不安定性スキャンモードで)トラップされたイオ ンを、質量選択的に放出することが可能となっている。中心軸線265は、細長い電極2 20、225、230および235に長手方向に平行であり、これによってイオントラッ プ200をイオントラップ質量スペクトルメータとして使用することが可能となる。この 質量スペクトルメータでは、例えば放出されたイオンを適当な検出器へ送り、質量対電荷 比の情報を得るようになっている。

[0023]

図示されるように、構造体内で所望される四極 R F 電位の等電位プロフィルに実質的に 一致する双曲面プロフィルを有する双曲面形状の細長い電極 2 2 0 、 2 2 5 、 2 3 0 およ び 2 3 5 により、二次元の実質的に四極の電位が発生される。しかしながら、直線形状ま たは他のカーブした電極形状によって、細長い電極 2 2 0 、 2 2 5 、 2 3 0 および 2 3 5 を形成することも可能である。同様に、開口部 2 5 5 の幾何学的形状は、一部は細長い電 極の形状および曲率に応じて決まる。

[0024]

二次元のイオントラップ200は、前記複数の細長い電極220、225、230および235と第1端部電極210および第2端部電極215と電気通信するコントローラ270を介して、二次元イオントラップ200が操作される。イオンを二次元イオントラップ200が捕捉し、トラップし、蓄積し、その後、質量対電荷比の大きさで、径方向に放出できるように、必要な電位を印加するようにコントローラ270は構成されている。

イオン放出中、二次元イオントラップ構造体200内に軸方向にイオンが注入される。 これらイオンは、Xの細長い電極220、225およびYの細長い電極230、235に 印加されるRF四極トラッピング電位により、イオンは径方向に保持される。端部電極2 10および215に軸方向のトラッピング電位、一般的にはDCオフセット電位を印加す ることにより、イオンは軸方向にトラップされる。注入イオンの運動エネルギーを低減し 、従ってリニアイオントラップのトラッピングおよび蓄積効率を高めるのを助けるのに、 約1×10<sup>-3</sup>トールの圧力のダンピングガス、例えばヘリウム(He)または水素(H<sub>2</sub>) )が使用される。イオンが注入された後に、このような衝突冷却が続き、この冷却はイオ ンクラウドのサイズおよびエネルギーの拡散を低減することを助け、このことは検出サイ クル中の分解能および感度を高める。 10



[0026]

短い蓄積時間 t<sub>1</sub>の後で、トラップされたイオンが質量対電荷比の大きさで不安定とな るようにトラッピングパラメータを変える。これを行うには、例えば、従来通り、複数の 細長い電極220、225、230および235のうちの少なくとも1つに印加されてい る周期的電圧を徐々に変え、検出方向にロッドの間に双曲AC共振注入電圧を加えながら 、RF電圧の大きさが時間 t<sub>2</sub>の間で、より高い大きさにリニアにランプ関数に従って変 化するよう、RF電圧の大きさを変える。図3にはこの放出プロセスが示されており、こ れら不安定なイオンはオントラップ構造体200の境界を越える軌跡を発生し、ロッド構 造体220内の開口部255または一連の開口部を通って電界から離間する。これらイオ ンは検出器を介して収集でき、その後、この検出器から得られた信号を利用して、最初に トラップされたイオンの質量スペクトルをユーザーに表示できる。

関連するタンデム型質量分析器、例えばフーリエ変換質量分析器、 R F 四極分析器、タイムオブフライト分析器、三次元イオントラップ分析器または静電分析器に後に軸方向に 注入できるよう、イオンを処理し、蓄積するのに、上記二次元イオントラップを使用する こともできる。

【0028】

この構造の重要な欠点は、軸方向のトラッピング電界がイオントラップ200の内部に 十分進入せず、イオンがトラップの中心から更に移動することが可能となっていることで ある。このことは、図1内の曲線110から理解できよう。この曲線110は端部レンズ に200Vを印加すると、1eVの軸方向エネルギーを有するイオンがほぼ40mm(中 心から±20mm)だけカバーするように広がることを示している。しかしながら、この ことは電極の端部におけるフリンジ電界および放出開口部の有限長さに起因して、イオン が軸方向の電界のより大きい不均一性を受け、イオントラップから放出されたイオンの検 出分解能が影響されることを意味する。

[0029]

本発明の1つの様相では、図4に示されるように、二次元イオントラップ200の内部 トラッピング空間240から外でイオンがスキャンされる間、これと同時にDCオフセッ トを徐々に変更する。この特定の例では、細長い電極220、225、230、235の うちの少なくとも1つに印加される周期的電圧(RF)(当初イオンをトラップするのに 使用されたのと同じ周期的電圧)および放出開口部255を含む少なくとも1つのXペア の細長い電極220および225に印加されるAC共振励起電圧を徐々に変えることによ リ、イオンは径方向にスキャンされている。徐々に変化する周期的DCオフセットの大き さは、デジタル - アナログコンバータによって可能となるように、大きさをランプ関数に 従って変えるか、または一連の離散的ステップで変えることができる。これとは異なり、 アナログ回路を使用する場合、コントローラ270は、更に図4に示されるように、徐々 に変化する周期的RF電圧を連続的に変えるようにすることもできる。

当初、二次元イオントラップ2000トラッピング容積内に最大数のイオンがトラップ されると、空間電荷容量を最大にすることが望ましい。本発明の別の様相によれば、低質 量対電荷比のイオンを質量分析する間は、低DCオフセットを加えることができ、イオン トラップ質量スペクトルメータのための代表的な分解能の仕様を満たすことができる。し かしながら、低DCオフセットの値は、当然、イオンを故意に注入しなければトラッピン グ空間内にイオンをトラップした状態に維持し、イオンが逃れないようにするのに必要な DCオフセットの値以上としなければならない。高質量対電荷比のイオンを質量分析する 間、高DCオフセットを印加できるので、これら値に対する分解能を最大にできる。高D Cオフセットを利用することは、作動中のこの時点での空間電荷容量を低減できるが、( 既に二次元イオントラップからは、より低い質量のイオンが放出されているので)実際に はトラッピング空間内には少ないイオンしかトラップされず、この結果、空間電荷容量は この時点であまり重要とはならない。

10

20

50

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ 

第 1 端部電極 2 1 0 または第 2 端部電極 2 1 5 のいずれか、またはその双方に徐々に変 化するDCオフセットを印加できる。これら電極のうちのいずれかまたはそれらの任意の 組み合わせに対するDCオフセットを徐々に変化させるという選択方法により、細長い電 極の他端よりも一端の近く、またはイオントラップの両端で生じる製造時の不正確さを補 償することが可能となる。

(8)

本発明の更に別の特徴によれば、サンプル分析の前にイオントラップ200を較正し、 高い値の質量対電荷比が、任意のタイプのスキャンに対する分解能の仕様内に入るか、ま たは許容できる指定された最大ピーク幅よりも低くできるようにするのに必要な、軸方向 の最小電位の値を提供するよう構成される。このような較正により、イオントラップから 放出されるイオンの質量対電荷比のレンジにわたって、分解能を最大にするよう、DCオ フセットをどのように徐々に変えるべきかを決定することが可能となる。これに関し、例 えば特定の質量対電荷比の値の、放出されるイオンに対して望まれる最大指定ピーク幅に 基づき、コントローラによってDCオフセットの大きさを制御することができる。一般に 、 測 定 機 器 ご と に ユ ニ ー ク な 較 正 が 必 要 で あ り 、 こ の 較 正 は 、 分 析 す る 質 量 対 電 荷 比 の 値 、または分析する質量対電荷比の値のレンジに応じて決まる。しかしながら、後に明らか となる理由から、異なるスキャンモードの間で、較正を変える必要はない。かかる較正中 」当業者には端部電極の一方または他方、もしくはその双方にDCオフセットを印加しな ければならないかどうかは明らかであろう。

図5および6には実験データが示されており、これら図は、空間電荷容量に対する影響 を最小にするのと同時に、特定の分解能(またはピーク幅)を得るためにイオンクラウド の軸方向の分散をどのように制御できるかを示している。

図5は、異なるスキャン条件のもとで、種々のm/z値のイオンに対して得られる分解 能のグラフを示す。分解能はピーク幅に関連しているので、このグラフ表示は質量対電荷 比に対するピーク幅の変化を示す。

[0035]

30 Aと表示されたマークであるダイヤモンド形状のマークで識別される曲線に従うと、m / z 比が通常のスキャンモード中に増加すると、ピーク幅も増加することが理解できよう 。 m/ z 1 8 2 2 で は 最 大 ピ ー ク 幅 は 0 . 7 m / z よ り 大 き く 、 こ れ に よ っ て 製 造 中 に こ のイオントラップが不合格となり得る。その理由は、通常のスキャン分解能の限界は、1 822であり、この限界は通常、 0.62 a m u の領域内にあるからである。約0.7 a m uより大きいピーク幅は、スペクトルデータの有効性を厳しく制限する。その理由は、等 方性イオンを互いに区別できないからである。これら基準によれば、このイオントラップ は不合格となり得る構造上の品質であると見なされ、品質管理要員によって不合格となる 可能性が最も高い。その理由は、12Vの固定された軸方向のDCオフセット電位を使用 する際に、m/z比1822では通常のスキャン分解条件を半分の回数しか満たすことが できないからである。

[0036]

Cで表示されたマークである正方形のマークで示されるように、より低速のスキャンモ ード(強化スキャンと称される)を実施するとき、m/z比が増加すると、ピーク幅はこ のスキャンレートに対し、0.45の最大製造仕様を再度1回超えることが理解できよう

[0037]

通常のスキャンレートを使ったDCオフセット較正を実行すると、Bで表示されたマー クである×アイコン(×)で示されるように、約46VのDCオフセットを印加した場合 、 m / z 比 1 8 2 2に対して 0.6 5 m / z よりも良好なピーク幅が得られると判断され た。トラッピング空間内にマークがトラップされたままとなることを保証するのに、12

10

∨の軸方向電位の値が知られている(12∨よりも低い電位の値でもこれを保証できる)のでm/z1822にて12から46へ徐々に変化するDCオフセット、すなわちm/z につき(46-12)/1822=約19m∨が必要である。図5は、このように徐々に 変化するDCオフセット電位を使用することにより、高いm/z値における分解能を大幅 に改善できることを示している。

【0038】

D C オフセット較正は、通常のスキャンレート(60μsec/amu)を使って実行 されたが、D および F によってそれぞれ示されるように、高いスキャンレート(200μ sec/amu)およびズームスキャンレート(900μsec/amu)の双方に対し て改善がなされることが分かった。

【0039】

端部電極210、215のうちの少なくとも1つで、徐々に変化するDCオフセットを 利用すると、ピーク幅が0.65 a m u より下まで低下することが分かる(分解能は既に 高くなっている)。この値は標準的なイオントラップの性能の仕様に近く、このデバイス が有効な質量スペクトルを発生するのを可能にする。

【0040】

ほとんどの方法を使って分解能を改善するための妥協方法は、イオンクラウドのサイズ が圧縮されることに起因し、空間電荷を増加し、デバイスの容量を小さくすることである 。図6は、イオントラップの容量を関数とする端部部分または端部電極の電圧のプロット を示す。この図は、2つの異なるm / z 比の値524.3 および1122に対する通常の スキャンレートにおける空間電荷許容度に対する、徐々に変化するDCオフセットの作用 を比較するものである。

20

30

10

【0041】

この特定のトラップが分解能の仕様をパスするのに必要とされる、46Vの固定された 軸方向の電位を利用する場合、空間電荷許容度を約30%だけ低減する。徐々に変化する DCオフセットを使用すると、m/z比524および1122における空間電荷許容度は 、約10%しか低減されないことが分かる。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 2 \end{bmatrix}$ 

高品質の構造の二次元イオントラップに対しては、DCオフセットを徐々に減少しなが ら変化させることが必要であり、このような制御はより大きい空間電荷容量を有する、よ り高い品位のイオントラップを提供するものである。例えば12Vの軸方向の固定電位を 使って1822で特定のイオントラップが0.69の平均ピーク幅を発生したことが分か っている。すべてのスキャンレートにおいて、分解能の較正を信頼できるようにパスする ピーク幅を提供するのに、m/zランプ関数レート当たり2.5mVだけでよいと判断さ れた。

[0043]

セグメント化されていない二次元のイオントラップを参照して説明したが、本発明の要 旨はセグメント化された二次元のイオントラップ、すなわち本明細書で参考例として援用 する「イオントラップ質量スペクトルメータシステムおよび方法」を発明の名称として、 1995年5月30日にビール氏外に発行された米国特許第5,420,425号に記載されてい るような他の構造の二次元イオントラップにも適用できる。この場合、端部電極が端部部 分の形状となり、各端部部分は細長い電極の対応する部分と同心状に配置された複数の電 極を備える。

[0044]

実際には、図7はビール氏外を発明者とする米国特許第5,420,425号の図2Aに示され たイオントラップに類似する二次元のイオントラップ300の斜視図である。図7のこれ ら二次元イオントラップは、図2を参照して説明し、示した、イオントラップ200の場 所を占める。図2の要素に類似する要素については、同じ番号を付けてある。図7のイオ ントラップ300は、単一セグメントの他に、図2の電極に類似する複数の細長い電極2 20、225、230、235を含む少なくとも1つの中心セグメント305を有する。

図 7 のイオントラップ300は、端部電極の代わりに第1端部セグメント310および第2端部セグメント315を有し、これらセグメントは端部電極のそれぞれの組を備える。 第1端部セグメント310は、第1の複数のロッド電極319、320、321および3 22を含む第1の組を有し、第2端部セグメント315は第2の複数のロッド電極311 、312;313、および314を含む第2の組を有する。端部セグメント310、31 5のロッド電極は、中心セグメント304の細長い電極と同時に配置できる。中心セグメ ント305の細長い電極の各々および図2の実施例に類似する端部セグメント310、3 15の電極の各々に、コントローラを接続できる。

[0045]

以上で、特定の実施例を参照し、説明のために実施例を説明した。しかしながら、これ <sup>10</sup> ら説明はすべてを網羅したものではなく、また本明細書に開示したものと同じ形態だけに 本発明を限定するものではない。上記要旨を検討すれば、多くの変更または変形が可能で ある。本発明の原理およびその実際的な使用を最良に説明するよう、実施例を説明し、考 えられる特定の用途に合いするように、当業者が種々の変形例と共に本発明および種々の 実施例を最良に利用できるようにした。

[0046]

本願は、本発明者により2006年6月5日に出願された米国仮特許出願第60/811,263 号に基づく優先権を主張するものである。

【図面の簡単な説明】

[0047]

【図1】種々のイオントラップ構造に対する軸方向トラッピング電位と軸方向位置との関 係を示すグラフである。

【図2】軸方向トラップのための端部電極と共に、単一断面の二次元イオントラップを示 す略図である。

【図3】イオントラップから質量対電荷比でイオンを放出するランプ関数状RF電位と共に、固定されたDCオフセットを印加することをグラフで示す。

【図4】イオントラップから質量対電荷比でイオンを放出する、徐々に変化する周期的電 圧(RF)と共に、徐々に変化するDCオフセットの印加をグラフで示す。

【図 5】異なるスキャン条件のもとでの種々のm / z値のイオンに対して得られる分解能 を示すグラフである。

- 【図 6 】端部部分または端部電極のオフセットを変えた場合の 2 つのm / z に対するイオ ントラップ容量の変化を示すグラフである。
- 【図7】軸方向トラップのための端部電極を形成する端部部分を有する複数の部分を備えた、二次元イオントラップの別の実施例の、図2に類似した斜視略図である。

【符号の説明】

[0048]

200 イオントラップ

- 210、215 電極
- 220、225 第1ペア
- 230、235 第2ペア
- 240 トラッピング空間
- 2 4 5 開口部
- 255 開口部

30

20











DCオフセット



【図4】





【図5】





【図6】









11

.

【国際調査報告】

.

	INTERNATIONAL CRADCH DEBO	DT	International app	onal application No.	
	INTERNATIONAL SEARCH REPO	RI	PCT/US07/1200	1	
CL/	ASSIFICATION OF SUBJECT MATTER				
IPC:	H01J 49/42( 2006.01);B01D 59/44( 2006.01)		<u>v.</u>		
USPC: according t	250/292,290,282,281 to International Patent Classification (IPC) or to both na	ational class	sification and IPC		
. FIE	LDS SEARCHED				
Ainimum d U.S. : :	ocumentation searched (classification system followed 250/292, 290, 282, 281	by classifi	cation symbols)		
ocumenta	tion searched other than minimum documentation to the	extent the	it such documents are included i	n the fields searched	
lectronic d AST Seam	ata base consulted during the international search (nam h: BRS ans IS&R:USPAT, US-PGPUB, USOCR, EPC	e of data b ), JPO, DE	ase and, where practicable, sear RWENT, IBM_TDB	ch terms used)	
. DO	CUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of document, with indication, where a	appropriate	, of the relevant passages	Relevant to claim No	
A	US 6,797,950 B2 (Schwartz et al.) 28 September 20 line 53 to col. 4, line 38.	04 (28.09.)	2004), abstract, Fig. 1, col. 3,	1-20	
х	US 2007/0158550 A1 (G.J. Wells) 12 July 2007 (12	abstract, Fig. 1, [0005, 0030,	1-20		
	0058].		, novinani, x 16. 7, (oooo, ooo7,		
				1	
	r documents are listed in the continuation of Box C		See patent family appex.	<u> </u>	
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of cited documents:		See patent family annex.	rrutional filing date or priority	
Furthe	r documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of cited documents: In defining the general state of the art which is not considered to be of it relevance		See patent family annex. inter document published after the inte date and not in conflict with the applia principle or theory maderlying the inve	mational filing date or priority ration but cited to understand the	
Furthe particula earlier a	er documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of sited documents: In defining the general state of the art which is not considered to be of at relevance application or patent published on or after the international filing date	- <b>T</b>	See patent family annex. Ister document published after the inte date and not in conflict with the applic principle or theory maderlying the inve- document of particular relevance; the considered navel or exampt be considered when the document is taken after	emailoaal fitting date or priority sation bus cited to understand the ration claimed invention cannot be tred to involve un inventive step	
Furthe docume particul earlier a docume establist apecifier	r documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of sited documents: In defining the general state of the art which is not considered to be of trefevance pplication or patent published on or after the international filing date at which may threw doubts on priority chain(s) or which is cited to the publication date of another citation or other special reason (as a)		See patent family annex. iter document published after the inte date and not in conflict with the appli principle or theory underlying the invo document of particular relevance; the considered navel or cannot be considered when the document is taken alone document of particular relevance; the considered to involve an investive are with one or more other such document	mational fiting date or priority ption but cited to understand the nation claimed invention cannot be tred to involve an inventive step claimed invention cannot be p when the document is combine to, such combination being	
Furthe docume particul earlier a docume establish apecifier docume	r documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of sited documents: In defining the general state of the art which is not considered to be of ur relevance splication or patent published on or after the international filing date at which may throw doubts on priority chim(s) or which is sited to the publication date of unother citation or other special reason (as a) at referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means at published prior to the international filing date but later than the	-x" -y" -y"	See patent family annex. ister document published after the inte date and and in conflict with the appli- principle or theory underlying the invo- document of particular relevance; the considered navel or exampt to conside when the document is taken alone document of particular relevance; the considered to involve an investive tar with one or more other such documen obvious to a person skilled in the art document member of the same patent	mational fitting date or priority stion hus cited to understand the intion claimed invention cannot be red to involve un inventive step claimed invention cannot be p when the document is combine in, such combination being family	
Furthe docume particula earlier a docume establish specifier docume priority	rt documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of sited documents: In defining the general state of the art which is not considered to be of trefevance pplication or patent published on or after the international filing date in which may threw doubts on priority chinic(s) or which is cited to the publication date of another citation or other special reason (as a) at referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means a published prior to the international filing date but later than the date claimed	-x -x -y	See patent family annex. ister document published after the inte date and not in conflict with the appli- principle or theory materlying the invo- document of particular relevance; the considered navel or camot be conside when the document is taken alone document of particular relevance; the considered to involve an investive ner- with one or more other such document obvious to a person skilled in the art document member of the same patent mailing of the interactions.	mational fitting date or priority stion but cited to understand the nation claimed invention cannot be red to involve an inventive step claimed invention cannot be p when the document is combine ts, such combination being family	
Furthe docume particul eartica docume establish specifier docume priority ate of the z	re documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of vited documents: at defining the general state of the art which is not considered to be of at relevance replication or patent published on or after the international filing date at which may throw doubts on priority chim(s) or which is exited to the publication date of another eitation or other special reason (as a) at referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means at published prior to the international filing date but ister than the date claimed sectual completion of the international search D08 (24.03.2008)	-Y" -Y" Date of	See patent family annex. Lear document published after the inte date and not in conflict with the applis principle or theory maderlying the invo- document of particular relevance; the considered novel or cannot be consid- when the document is taken alone document of particular relevance; the considered is involve as investive are with one of some other such document obvious to a person skilled in the art document member of the same patent mailing of the international scent A 2 APR 20	crissional fitting date or priority pristion but cited to understand the nation claimed invention cannot be cred to involve an inventive step owhere the document is combine to, such combination being family ch report	
Furthe particul earlier a docume establish apecifier docume priority ate of the a March 20 ame and m	er documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of sited documents: In defining the general state of the art which is not considered to be of it relevance splication or patent published on or after the international filing date: In which may throw donbts on priority chim(s) or which is eited to the publication date of unother citation or other special reason (as 3) at referring to as and disclosure, use, exhibition or other means in published prior to the international filing date but later than the date claimed textual completion of the international search NOS (24.03.2008) hailing address of the ISA/US	-x" -y" -a. Authorit	See patent family annex. Later document published after the inter- date and not in conflict with the appli- principle or theory matching the invo- document of particular relevance; the considered navel or cannot be consider when the document is taken alone document of particular relevance; the considered to involve as investive are with one of some other such documen obvious to a person skilled in the art document member of the same patient mailing of the international scar <u>0 2 APPR 20</u> peed officer, <u>0</u>	mational filing date or priority phion but cited to understand the suiton claimed invention cannot be read to involve an inventive step claimed invention cannot be p when the document is combian is, such combination being family ch report	
Furthe docume particula earlier a docume establish docume priority ate of the a March 20 anne and m Mi C C	er documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of sited documents: In defining the general state of the art which is not considered to be of a relevance application or patent published on or after the international filing date the which may throw donbts on priority chim(s) or which is cited to the publication date of another citation or other special reason (as a) are referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means a published prior to the international filing date but later than the date claimed actual completion of the international search NO8 (24.03.2008) hailing address of the ISA/US sil Stop PCT, Attn: ISA/US turnisisioner for Patents	-X" -Y" Date of f Nikita N	See patent family annex. Later document published after the inte date and not in conflict with the appli- principle or theory matching the invo- document of particular relevance; the considered novel or exampt to conside when the document is taken alone document of particular relevance; the considered to involve as investive sta- with one or more other such documen obvious to a person abilited in the at- document member of the same patent mailing of the international scar O 2 APR 20 peed officer Wells	minimal fitting date or priority prior but cited to understand the intion claimed invention cannot be read to involve un inventive step claimed invention cannot be p when the document is combine its, such combination being family ch report DB UBA	

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM), EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MT,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA( BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH, CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,K R,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC

## (74)代理人 100098475

- (72)発明者 センコ マイケル ダブリュー アメリカ合衆国 カリフォルニア州 94086 サニーヴェイル ラ メサ テラス 994ビ
- (72)発明者 シュウォーツ ジェイ シー アメリカ合衆国 カリフォルニア州 95020 ギルロイ ブライドル パス ドライヴ 25 25
- Fターム(参考) 2G041 CA01 GA03 GA08 GA13 5C038 JJ06 JJ07